Attorney Docket No. 033697-008



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Ir	re	-	ate	nt .	App	Olic	atı	on	ot
----	----	---	-----	------	-----	------	-----	----	----

Hideharu Hironaka

Application No.: 10/720,518

Filed: November 25, 2003

NORMALLY CLOSED SOLENOID-For:

OPERATED VALVE

Group Art Unit: 3751

Examiner: JOHN BASTIANELLI

Confirmation No.: 5146

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following priority foreign application in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed.

Country:

JAPAN

Patent Application No.:

2002-347509

Filed:

November 29, 2002

In support of this claim, enclosed is a certified copy of said foreign application. Said prior foreign application is referred to in the oath or declaration and/or the Application Data Sheet. Acknowledgement of receipt of this certified copy is requested.

Respectfully submitted,

BURNS, DOANE, SWECKER & MATHIS, L.L.P.

Date: June 9, 2005

Matthew L. Schneider

Registration No. 32,814

P.O. Box 1404 Alexandria, Virginia 22313-1404 (703) 836-6620

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されてる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed ith this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年11月29日

出願番号 Application Number:

特願2002-347509

ST. 10/C]:

[JP2002-347509]

願 人 plicant(s):

株式会社アドヴィックス

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 1月26日





【書類名】

特許願

【整理番号】

IP02-078

【提出日】

平成14年11月29日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

F16K 31/06

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 株式会社アドヴィッ

クス内

【氏名】

弘中 秀晴

【特許出願人】

【識別番号】

301065892

【氏名又は名称】 株式会社アドヴィックス

【代理人】

【識別番号】

100089082

【弁理士】

【氏名又は名称】

小林 脩

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

155207

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

0116504

【プルーフの要否】

要

【書類名】明細書

【発明の名称】 常閉型開閉電磁弁

【特許請求の範囲】

【請求項1】 筒状のスリーブと、該スリーブの一端に設けられた固定子と、該固定子に対向して前記スリーブ内に摺動可能に嵌合されるとともに前記スリーブの内面との間で作動液の流通を許容する連通溝が軸方向両端間に渡って外面に設けられた可動子と、前記固定子および前記可動子を励磁する電磁コイルとを備えた常閉型開閉電磁弁において、前記固定子の前記可動子に対向する固定子端面と前記可動子の前記固定子に対向する可動子端面との間に閉壁によってダンパ室が形成され、前記可動子が前記電磁コイルによって励磁されて前記固定子側に移動し、前記ダンパ室が前記固定子端面と前記可動子端面とによって閉塞されたときに、前記ダンパ室と前記連通溝とが所定絞りによって連通されることを特徴とする常閉型開閉電磁弁。

【請求項2】 請求項1において、前記固定子端面と前記可動子端面との間に環 状シムを介装して前記ダンパ室を形成するとともに、前記固定子端面および前記 可動子端面のうち少なくともいずれか一方に前記連通溝に連通する凹溝を設けて 前記所定絞りとしたことを特徴とする常閉型開閉電磁弁。

【請求項3】 請求項1において、前記固定子端面と前記可動子端面との間に環状シムを介装して前記ダンパ室を形成するとともに、前記環状シムと前記連通溝との重合しない部位を前記所定絞りとしたことを特徴とする常閉型開閉電磁弁。

【請求項4】 請求項1において、前記固定子端面および前記可動子端面のうち少なくともいずれか一方に環状凸部に囲まれた凹部を形成して前記ダンパ室とし、前記環状凸部に前記連通溝に連通する凹溝を設けて前記所定絞りとしたことを特徴とする常閉型開閉電磁弁。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、常閉型開閉電磁弁に関する。

[0002]

【従来技術】

この種の常閉型開閉電磁弁の一つとして、筒状のスリーブと、このスリーブの一端に設けられた固定子と、この固定子に対向してスリーブ内に摺動可能に嵌合されるとともにスリーブの内面との間で作動液の流通を許容する連通溝が軸方向両端間に渡って外面に設けられた可動子と、固定子および可動子を励磁する電磁コイルとを備えたものが知られている(特許文献1参照)。

[0003]

この常閉型開閉電磁弁には可動子を挟んでダンパ室と弁室が形成されるとともに、可動子の外周壁面にはシール部材が取り付けられており、このシール部材の一部外周に両端に至るV溝が形成されていて、このV溝によって弁室とダンパ室を連通する絞り通路が形成されている。

[0004]

【特許文献1】

特開平8-93955号公報(第5ページ、図7、図8)

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

上述した常閉型開閉電磁弁においては、弁室とダンパ室は固定絞りの通路によってのみ連通しているので、図3にて破線で示すように、可動子が移動して固定子に接近しても可動子の移動に関係なく絞り面積は一定である。つまり可動子(弁体)の移動全域に渡りダンパ効果が作用する。これにより、電磁弁の作動応答遅れが生じる。一方、電磁弁の作動応答性を優先するとダンパ効果を十分に得ることができなくなり、作動音低減効果を十分に得ることができなくなるという問題があった。また、シール部材を使用しているので、その分製造費用が上昇するという問題があった。

[0006]

本発明は、上述した各問題を解消するためになされたもので、電磁弁の開閉作動に伴う作動音を効果的に抑制し、かつ電磁弁の作動応答遅れを防止する安価な電磁弁を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するため、請求項1に係る発明の構成上の特徴は、筒状のスリーブと、このスリーブの一端に設けられた固定子と、この固定子に対向してスリーブ内に摺動可能に嵌合されるとともにスリーブの内面との間で作動液の流通を許容する連通溝が軸方向両端間に渡って外面に設けられた可動子と、固定子および可動子を励磁する電磁コイルとを備えた常閉型開閉電磁弁において、固定子の可動子に対向する固定子端面と可動子の固定子に対向する可動子端面との間に閉壁によってダンパ室が形成され、可動子が電磁コイルによって励磁されて固定子側に移動し、ダンパ室が固定子端面と可動子端面とによって閉塞されたときに、ダンパ室と連通溝とが所定絞りによって連通されることである。

[0008]

請求項2に係る発明の構成上の特徴は、請求項1において、固定子端面と可動 子端面との間に環状シムを介装してダンパ室を形成するとともに、固定子端面お よび可動子端面のうち少なくともいずれか一方に連通溝に連通する凹溝を設けて 所定絞りとしたことである。

[0009]

請求項3に係る発明の構成上の特徴は、請求項1において、固定子端面と可動 子端面との間に環状シムを介装してダンパ室を形成するとともに、環状シムと連 通溝との重合しない部位を所定絞りとしたことである。

$[0\ 0\ 1\ 0\]$

請求項4に係る発明の構成上の特徴は、請求項1において、固定子端面および 可動子端面のうち少なくともいずれか一方に環状凸部に囲まれた凹部を形成して ダンパ室とし、環状凸部に連通溝に連通する凹溝を設けて所定絞りとしたことで ある。

[0011]

【発明の作用・効果】

上記のように構成した請求項1に係る発明においては、電磁コイルによって励磁された可動子が移動して固定子に接近すると、ダンパ室内の作動液は固定子端面または可動子端面と閉壁との隙間および所定絞りを通って連通溝に流出する。

そして、可動子が固定子に当接して、ダンパ室が固定子端面と可動子端面によって閉塞されたときに、ダンパ室と連通溝は所定絞りによって連通される。このように、可動子が固定子に近接しているときには可動子が固定子に接近するにつれてダンパ室と連通溝とを連通する通路面積が減少して絞り抵抗が増大し、可動子の移動速度が減少し、可動子が固定子に当接するときに発生する作動音を十分に低減することができる。また、可動子が固定子から離間しているときには固定子端面または可動子端面と閉壁との隙間が広くダンパ室の作動液はほとんど絞られることなく連通溝を通って流出入できるので、可動子は応答性よく移動することができる。したがって、シール部材などの部品を追加することなく、電磁弁の開閉作動に伴う作動音を効果的に抑制し、かつ電磁弁の作動応答遅れを防止することができる安価な開閉電磁弁を提供することができる。

[0012]

上記のように構成した請求項2に係る発明においては、請求項1において、固定子端面と可動子端面との間に環状シムを介装してダンパ室を形成するとともに、固定子端面および可動子端面のうち少なくともいずれか一方に連通溝に連通する凹溝を設けて所定絞りとしたので、電磁コイルによって励磁された可動子が移動して固定子に接近すると、ダンパ室内の作動液は固定子端面または可動子端面と環状シムとの隙間と凹溝を通って連通溝に流出する。このように環状シムと凹溝を設ける簡単な構成により請求項1に記載の発明と同様な作用・効果を得ることができる。

[0013]

上記のように構成した請求項3に係る発明においては、請求項1において、固定子端面と可動子端面との間に環状シムを介装してダンパ室を形成するとともに、環状シムと連通溝との重合しない部位を所定絞りとしたので、電磁コイルによって励磁された可動子が移動して固定子に接近すると、ダンパ室内の作動液は固定子端面または可動子端面と環状シムとの隙間と、環状シムと連通溝との重合しない部位を通って連通溝に流出する。このように環状シムを設けるだけで上述した作用・効果を得ることができる。

[0014]



上記のように構成した請求項4に係る発明においては、請求項1において、固定子端面および可動子端面のうち少なくともいずれか一方に環状凸部に囲まれた凹部を形成してダンパ室とし、環状凸部に連通溝に連通する凹溝を設けて所定絞りとしたので、電磁コイルによって励磁された可動子が移動して固定子に接近すると、ダンパ室内の作動液は固定子端面または可動子端面と環状凸部との隙間と凹溝を通って連通溝に流出する。このように凹溝を有する環状凸部を設けるだけで上述した作用・効果を得ることができる。

[0015]

【発明の実施の形態】

以下、本発明による常閉型開閉電磁弁の第1の実施の形態を図面を参照して説明する。図1はこの常閉型開閉電磁弁を示す軸方向断面図である。

[0016]

この常閉型開閉電磁弁 V は、図1に示すように、円筒状に形成されたスリーブ 11を備えていて、スリーブ11の下部がバルブボディ12に設けた取付孔12 a に挿入されかしめられて液密に固定されている。スリーブ11の上部はバルブボディ12から突出しており、スリーブ11の上端にはスリーブ11の上部と同径に形成された円柱状の固定子13が同軸的かつ一体的に設けられている。なお、固定子13とスリーブ11の境界部には可動子18の上端部に対向して非磁性体11aが介在されている。また、固定子13の軸心部には軸孔13aが形成されており、この軸孔13a内には圧縮スプリング14が収容されている。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

固定子13の外周には固定子13とスリーブ11の突出部(スリーブ11の上部)を覆うほぼ円筒状のヨーク15が固定されている。ヨーク15の上端開口部は固定子13の上端部に嵌合固定され、ヨーク15の下端は取付孔12aまで延設されており、この下端開口の内周壁とスリーブ11の外周壁との間にリング16が嵌着されている。このヨーク15の内側には固定子13とスリーブ11の上部を覆う電磁コイル17がスリーブ11と同軸的に配設され、電磁コイル17はヨーク15に固定されている。

$[0\ 0\ 1\ 8]$

6/



スリーブ11、固定子13、ヨーク15、リング16および可動子18(後述する)は磁性体であり、電磁コイル17が通電されると、電磁コイル17のまわりに固定子13、ヨーク15、リング16、スリーブ11および可動子18に沿った磁路が形成されて、固定子13および可動子18が励磁される。

[0019]

スリーブ11の軸孔11c内の下端部には弁座部材19が嵌着され、弁座部材19と固定子13との間の軸孔11c内には可動子18が固定子13に対向して摺動可能に嵌合されている。弁座部材19には弁孔19aが同軸的に形成されている。弁孔19aの上端開口縁には弁座19bが形成され、弁孔19aの下端開口は取付孔12aの底に開口する流出通路P2に臨んでいる。

[0020]

可動子18は大径部18aと大径部18aの下部に一体的かつ同軸的に形成された小径部18bから形成されている。大径部18aの上端面には圧縮スプリング14の下端が当接しており、可動子18が圧縮スプリング14によって図示下方(弁の閉塞方向)に向けて付勢されている。小径部18bの下端には弁体21が一体的に設けられており、弁体21は可動子18と連動して移動するようになっている。すなわち、電磁コイル17の非通電時には可動子18が圧縮スプリング14によって下方に付勢され弁体21が弁座19bに当接して弁座部材19の弁孔19aを閉鎖し、電磁コイル17の通電時には可動子18が圧縮スプリング14に抗して固定子13に向けて移動され弁体21が弁座19bから離間して弁孔19aを開放する。

[0021]

可動子18の大径部18aの上端面と固定子13の下端面との間には、図1および図2に示すように、電磁コイル17の非通電時において所定の隙間が設けられており、この隙間とスリーブ11の軸孔11cと後述する環状シム24とから液室R1が形成されている。なお、隙間は可動子18の作動ストローク長に対応している。

[0022]

可動子18の小径部18bとスリーブ11の内周壁面と弁座部材19とから弁



室R2が形成されている。また、可動子18の大径部18aの外周壁面には、液室R1と弁室R2との間で作動液の流通を許容する一対の連通溝22,22が軸方向に設けられている。

[0023]

可動子18の大径部18aの上端面には、閉壁としての環状シム24が取り付けられている。環状シム24は、ほぼ楕円形に形成されており、可動子18に設けられた連通溝22の開口とオーバーラップしないように配置されていて、係合 爪25によって連通溝22に係合されている。そして、固定子13の下端面と可動子18の上端面との間に、環状シム24によってダンパ室R3が形成される。

[0024]

すなわち、スリーブ11の軸孔11c内の上部および下部には、可動子18を 挟んでダンパ室R3と弁室R2とが形成されている。

[0025]

電磁コイル17が通電状態となり可動子18が上方に移動して固定子13に接近すると、ダンパ室R3内の作動液は、液室R1および一対の連通溝22,22 を通って弁室R2に流出し、電磁コイル17が非通電状態となり可動子18が下方に移動して固定子13から離間すると、弁室R2内の作動液は、一対の連通溝22,23および液室R1を通ってダンパ室R3内に流入する。

[0026]

弁室R2はスリーブ11に設けられた連通孔11bおよびスリーブ11の外周 壁面に取り付けられたフィルタ23を介してバルブボディ12に設けた流入通路 P1に連通するとともに、弁孔19aを介して流出通路P2に連通している。

[0027]

また、可動子18の上端面の周縁部であって連通溝22が形成されてない部位には、図2に示すように、径方向に端面まで延びる所定絞りとしての凹溝26が形成されている。これにより、可動子18が電磁コイル17によって励磁されて固定子13側に移動し、ダンパ室R3が固定子13の下端面と可動子18の上端面に取り付けられた環状シム24とによって閉塞されたときに、ダンパ室R3と連通溝22とが凹溝26によって連通される。なお、凹溝26の径方向の長さは



環状シム24の幅より大きくなるように設定されていて、凹溝26の内側端が環状シム24の内周壁より内側に配置される。また、凹溝26は断面三角状に形成されており、この断面積は ϕ 0.4 mmに相当する面積となるように設定するのが好ましい。なお、凹溝26の断面形状は三角状に限られるものでなく方形状、半円弧状でもよい。

[0028]

上記のように構成した開閉電磁弁Vにおいては、電磁コイル17によって励磁された可動子18が移動して固定子13に接近すると、ダンパ室R3内の作動液は、固定子13の下端面と閉壁である環状シム24との隙間hおよび環状シム24の内周壁面24aの円周1から通路面積がh×1であるリング状の可変絞り、および所定絞りである凹溝26を通って連通溝22に流出する。この可変絞りは、図3に示すように、可動子18が固定子13に接近するにつれて通路面積が減少し、絞り抵抗が増大する。そして、可動子18に設けた環状シム24が固定子13に当接して、ダンパ室R3が固定子13の下端面と可動子18の上端面によって閉塞されたときに、ダンパ室R3と連通溝22は凹溝26によってのみ連通される。

[0029]

上述した説明から理解できるように、この第1の実施の形態においては、可動子18が固定子13に近接しているときには可動子18が固定子13に接近するにつれて可動子18の軸方向両端間を連通する通路面積が減少して絞り抵抗が増大し、可動子18の移動速度が減少し、可動子18が固定子13に当接するときに発生する作動音を十分に低減することができる。また、可動子18が固定子13から離間しているときには固定子13の下端面と環状シム24との隙間hが広くダンパ室R3の作動液はほとんど絞られることなく連通溝22を通って流出入できるので、可動子18は応答性よく移動することができる。したがって、シール部材などの部品を追加することなく、電磁弁の開閉作動に伴う作動音を効果的に抑制し、かつ電磁弁の作動応答遅れを防止することができる安価な開閉電磁弁を提供することができる。

[0030]



なお、上述した実施の形態においては、凹溝26を可動子18の上端面に設けたが、固定子13の下端面に設けるようにしてもよく、可動子18の上端面と固定子13の下端面の両方に設けるようにしてもよい。

[0031]

また、上述した実施の形態においては、環状シム24を可動子18に取り付けるようにしたが固定子13に取り付けるようにしてもよい。このとき、ダンパ室R3内の作動液は可動子18の上端面と閉壁である環状シム24との隙間いわゆるリング状の可変絞りおよび所定絞りである凹溝26を通って連通溝22に流出する。

[0032]

第2の実施の形態について図4を参照して説明する。なお第1の実施の形態と 同一構成要件については同一符号を付してその説明を省略する。上述した第1の 実施の形態においては、固定子13の下端面と可動子18の上端面との間に環状 シム24を介装するとともに可動子18の上端面に凹溝26を設け、ダンパ室R 3を固定子13の下端面と可動子18の上端面との間に環状シム24によって形 成し、所定絞りを凹溝26により形成したが、これに代えて、図4に示すように 、固定子13の下端面と可動子18の上端面との間に環状シム124を介装し、 ダンパ室R13を固定子13の下端面と可動子18の上端面との間に環状シム1 24によって形成し、所定絞りを環状シム124と連通溝22との重合しない部 位とし、すなわち環状シム124の内周壁面124aに連通溝22の一部分が開 口するようにして所定絞りを形成するようにしてもよい。例えば、環状シム12 4の内周壁面124a下端と可動子18の連通溝22の開口上端との隙間Sとに よって所定絞りを形成する。このとき、電磁コイル17によって励磁された可動 子18が移動して固定子13に接近すると、ダンパ室R3内の作動液は固定子1 3の下端面または可動子18の上端面と環状シム124との隙間と、環状シム1 24と連通溝22との重合しない部位すなわち隙間Sを通って連通溝22に流出 する。これによっても、上述した実施の形態と同様な作用および効果を得ること ができるのに加えて、可動子18に凹溝26を形成したり環状シム24に爪25 を設けるなどの加工を施す手間を削除できるので、構造を簡単にし、コストを低



減することができる。

[0033]

また、上述した第2の実施の形態においては、環状シム124を介装する代わりに、このシム124に相当する環状凸部を固定子13の下端面に設けるようにしてもよい。このとき、可動子18が固定子13に当接してダンパ室R13が固定子13の下端面と可動子18の上端面とによって閉塞されたときに、所定絞りは環状凸部の内周壁面下端と可動子18の連通溝22の開口上端との隙間とによって形成される。

[0034]

第3の実施の形態について図5を参照して説明する。なお第1の実施の形態と 同一構成要件については同一符号を付してその説明を省略する。上述した第1の 実施の形態においては、固定子13の下端面と可動子18の上端面との間に閉壁 としての環状シム24を介装するとともに可動子18の上端面に凹溝26を設け 、ダンパ室R3を固定子13の下端面と可動子18の上端面との間に環状シム2 4によって形成し、所定絞りを凹溝26により形成したが、これに代えて、図5 に示すように、可動子18の上端面の周縁部に閉壁としての環状凸部224を設 けるとともにこの環状凸部224に凹部224aを設け、ダンパ室R23を環状 凸部224に囲まれた凹部によって形成し、所定絞りを凹部224aにより形成 するようにしてもよい。なお、凹部224aは、図5に示すように連通溝22に 開口するように設けてもよいし、環状凸部224の円周方向の任意の位置であっ て連通溝22に開口しない位置に設けてもよい。このとき、電磁コイル17によ って励磁された可動子18が移動して固定子13に接近すると、ダンパ室R23 内の作動液は固定子13の下端面と環状凸部224との隙間と凹溝224aを通 って連通溝22に流出する。このように凹溝224aを有する環状凸部224を 設けるだけで上述した作用・効果を得ることができるのに加えて、環状シムを設 けなくてよくなるので、部品点数を低減し、コストを低減することができる。な お、環状凸部224を可動子18の上端面に設ける代わりに、固定子13の下端 面に設けるようにしてもよく、また環状凸部224を可動子18の上端面と固定 子13の下端面の両方に設けるようにしてもよい。

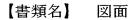


【図面の簡単な説明】

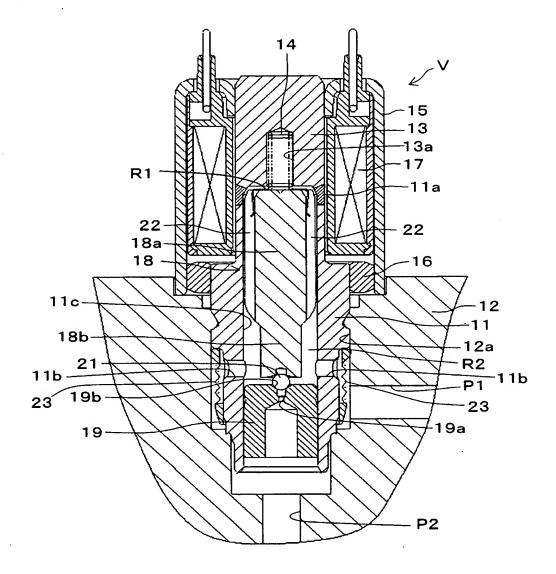
- 【図1】 本発明による常閉型開閉電磁弁の第1の実施の形態の軸方向断面図である。
- 【図2】 (a)は図2に示したダンパ室を示す軸方向部分拡大断面図であり、(b)は可動子の平面図である。
- 【図3】 可動子の位置と通路面積との関係を示す図である。
- 【図4】 (a) は本発明による常閉型開閉電磁弁の第2の実施の形態のダンパ室を示す軸方向部分拡大断面図であり、(b) は可動子の平面図である。
- 【図5】 (a) は本発明による常閉型開閉電磁弁の第3の実施の形態のダンパ室を示す軸方向部分拡大断面図であり、(b) は可動子の平面図である。

【符号の説明】

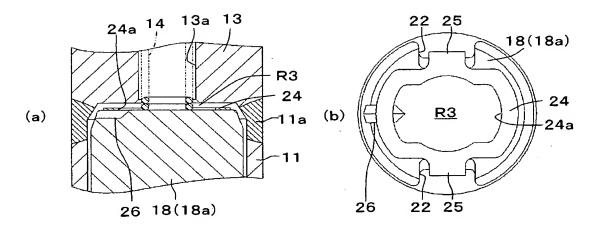
11…スリーブ、12…バルブボディ、13…固定子、14…圧縮スプリング、15…ヨーク、16…リング、17…電磁コイル、18…可動子、19…弁座部材、19a…弁孔、19b…弁座、21…弁体、22…連通溝、24,124…環状シム、26…凹溝(所定絞り)、224…環状凸部、224a…凹部(所定絞り)、R1…液室、R2…弁室、R3,R13,R23…ダンパ室。



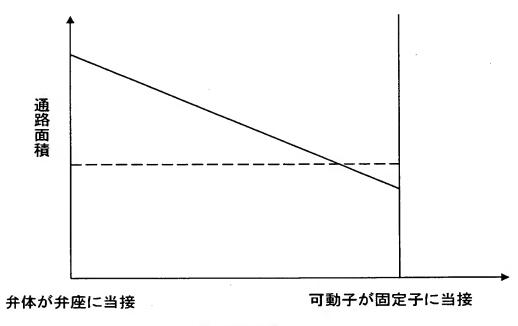
【図1】



【図2】

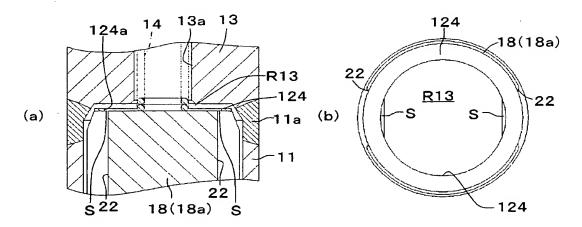


【図3】

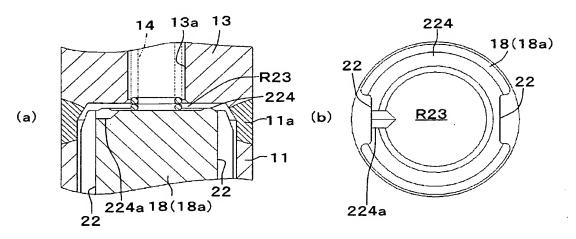


可動子の位置





【図5】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電磁弁の開閉作動に伴う作動音を効果的に抑制し、かつ電磁弁の作動 応答遅れを防止する安価な常閉型電磁弁を提供する。

【解決手段】 常閉型開閉電磁弁 V は、筒状のスリーブ11の一端に設けられた 固定子13と、固定子13に対向してスリーブ11内に摺動可能に嵌合されると ともにスリーブ11の内面との間で作動液の流通を許容する連通溝22が軸方向 両端間に渡って外面に設けられた可動子18と、固定子13および可動子18を 励磁する電磁コイル17を備えている。互いに対向する固定子13の下端面と可動子18の上端面との間に環状シム24によってダンパ室R3が形成され、ダンパ室R3が固定子13の下端面と可動子18の上端面とによって閉塞されたとき に、ダンパ室R3と連通溝22とが凹溝26によって連通される

【選択図】 図2

特願2002-347509

出願人履歴情報

識別番号

[301065892]

1. 変更年月日

[変更理由] 住 所 氏 名 2001年10月 3日

新規登録

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

株式会社アドヴィックス